AATE

=> s 93-130050/an L8 1 93-130050/AN

249/300 AJ p.1

=> d all

L8 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD AN ****93-130050**** [16] WPINDEX

TI Discharge excitation pulse gas laser device e.g. excimer laser - has static gas room to form space to eliminate generation gas flow thus prevents metallic dust from attaching to optical window surface NoAbstract.

DC V08
PA (NIDE) NEC CORP
CYC 1
PI JP 05067823 A 930319 (96)* 5 pp H01S003-038
ADT JP 05067823 A JP 91-225743 910905
PRAI JP 91-225743 910905
IC ICM H01S003-038
ICS H01S003-097
FS EPI
FA NOAB; GI

MC EPI: V08-A01; V08-A02C; V08-A04B

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号。

特開平5-67823

(43)公開日 平成5年(1993)3月19日

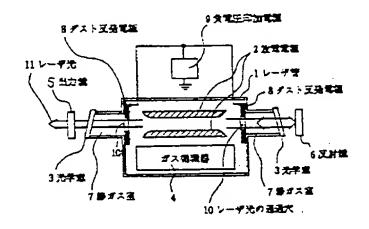
(51) Int.Cl. ³ H 0 1 S 3/038 3/097	識別記 号	庁内亞理爭号	FI			技術表示箇所	
		8934 – 4M 8934 – 4M	H01S	3/ 03 3/ 097		B Z	
			1	審查請求	未請求	請求項の数3(全 5 頁)	
(21)出額番号	(1) 出願番号 特顏平3-225743		(71)出願人 000004:237 日本電気株式会社				
(22) 出類日	平成3年(1991)9月5日		(72)発明者	伊藝	#二	丁目7番1号 丁目7番1号日本 建 気株式	
			(74)代理人		内原	T	
				•			
	, .						

(54) 【発明の名称】 放電励起パルスガスレーザ装置

(57)【要約】

[目的] 放電によって発生する金属ダストの光学窓への 堆積・付着を防ぎ、光学窓の寿命向上を図る。

【構成】光学窓3の近傍に静ガス室7を設けてガス循環によってもガスの流れを生じない空間を形成し、ガス循環器4によりガスが脱はんされても、放電で発生した金電ダストが光学窓3の表面に到達しにくい構造を操ると同時に、静ガス室7内部のガスの流れの無い空間ととして、静ガス魔環される空間の境界に誘導放出光11が通過できる通過六10を有するダスト反発電極8を設置し、この電極8に負荷電圧印加電源9によって負の電圧を印加する構成を探ることによって、放電によって、放電が負の電荷に帯電している金属ダストのガス室7内部への侵入をクーロンカによって防ぐ。



【特許顕求の範囲】

【讃求項1】 レーザガスを封入するレーザ苦と、放電 により前記レーザガスを励起して光の誘導放出を起こさ せる一対の放電電極と、前記放電電極間隙の放電空間に 前記シーザガスを表すガス循環器と、前記誘導放出の光 路に配置された一対の光学窓及びレーザ共振器を構成す る反射変とを少なくとも備えた放電励起バルスガスレー プ長置において、前記光学窓近房に前記ガス循環があっ てもガスの流れの生じない空間を形成する静ガス室を設 け、前記誘導致出光が通過できる通過穴を有する電極に よって、前記算ガス室内部のガスの流れの無い空間と前 記レーデ苦内のガス循環される空間とを隔離し、前記載 極(以下、ダスト反発電極と称す)に負の電圧を印加す ることを特徴とする致電励起パルスガスレーデ装置。

【請求項2】 請求項1記載の数電励起パルスガスレー **ザ芸萱において、前記ダスト反発電腦の近券に第1のコ** ロナ電極及び第2のヨロナ電極からなる、コロナ放電器 - を設置した敦電励起バレスガスレーザ装置。

【請求項3】 請求項1記載の放電励起パレスガスレー デ芸置において、前記シーデ音と前記静ガス宣を配音、 ガス循環ボンプ及びダストフィルタのよって直列に接続 した放電励起パルスガスレーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エキシマレーザ等の故 電団起バルスガスレーが装置に関する。

[0002]

【従来の技術】放電励起バルスガスレーザ装置は、放電 による玄重電極のスパッターで多量の金属ダストがレー **ザガス中に発生する。この金属ダストは、光学窓に付着**。 してレーザ出力を減少させると同時に、光学窓の寿命を 著しく劣化させる原因となっている。 従来の放電励起 バルスガスレーザ芸量では、レーザ管外部に設置した循 異ポンプによってレーザガスの一部を取り出し、ダスト フィルターもしくは電気集基器に通じた後、再びレーザ 管に関す構成を取ることによって、レーザガス中に発生 した金属ダストを除去している(例えば、特開昭58-136335号公银参照)。

[0003]

装置では、レーザ管内に発生した全国ダストを完全に除 |玉することが難しいこと、及び金属ダストと光学窓の接 触を避ける手段を何も有していないことから、レーザを 長時間動作させると光学窓に金属ダストが推積する問題 点を育する。光学窓が汚れると、光学窓をクリーエング もしくは交換しなければならないので、保守及びランニ ングコスト上大きな問題である。なお、この金属ダスト による光学窓の汚れの問題は、「レーザ・フォーガス (LaserFocus) 1 1981年、10月号、6 5 - 6 8 ページ」に詳しく記述されている。

【0004】本発明の目的は、このような問題点を解決 した放電励起パルスガスレーザ装置を提供することにあ

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の放進制器パルス ガスレーザ装置は、レーザガスを封入するシーデ奮と、 放電により前記レーデガスを励起して光の誘導改出を記 こさせる改造電腦方と、前記改造電腦間隔の改造空間に 前記レーザガスを調すガス循環器と、前記誘導改出光の 10 光路に配置された一対の光学窓をとを少なくとも備えた 牧電励起パルスガスレーザ装置において、前記光学窓近 房に前記ガス循環があってもガスの流れの主じない空間 を形成する静ガス室を設け、前記誘導放出光が通過でき る通過穴を有する電極によって、前記静ガス室内部のガ スの流れの無い空間と前記レーザ管内のガス循環される 空間とを開離し、前記電極(以下、ダスト支発電極と称 す)に負の電圧を印加することを特徴とする。また、前 記ダスト反発電振の近傍に第1のコロナ電極及び第2の コロナ電極からなるコロナ放電器を設置したことを持張 とする。さらに、前記レーザ管と前記ガス室を配管、ガ ス循環ボンプ及びダストフィルタによって国別に接続し たことを特徴とする。

[0005]

【作用】光学忠近時にガス循環器によるガス循環があっ てもガスの流れの生じない空間を形成する静でス室を設 けることによって、ガス循環器によってガスが提ばんぎ れても放電で発生した金属ダストが光学窓の表面に到達 し、付着・堆積することを抑制できる。また、ダスト等 の強粒子は負の電荷に帯電し易いため、シープガス中に |発生した大部分の全国ダストは改電で発生した電子を吸 着し負の電荷に帯電している。したがって、静力ス室内 部のガスの流れの無い空間とレーザ音内のガス循環され る空間の境界に誘導改出光が通過できる通過穴を有する ダスト反発電腦を設置し、この電腦に負の電圧を印加す る構成を採ることによって、負の重荷に帯電して色層系 ストはグーロンカによって発ガス室内部に入り込めな。 い。結果として、故電で発生した全属ダストが光学窓の 表面に到達し、付着・準積することが抑制される。まら に、ダスト反発電極の近海に第1のコロナ電極及び第2 【角明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の一般。のココナ電極からなるココナ放電器を設置し、ココナ改 重器を起こすことによって、負の電荷に帯電していない 幾りの金属ダストを効率よく負の遺荷に搭進させること が可能である。したがって、金属ダストの静力ス宝への **受入をより完全に抑制することが可能となる。**

> 【000~】このため、本発明の構成を取ることによ り、光学窓への全国ダストの堆積・付着を防ぎ、長時間 にわたり安定なシーザ出力を得ることが可能になる。字 た、光学窓のクリーニング及び交換の回数を延減するこ とができるため保守が容易になると同時に、ランエング 50 コスト上有利となる。

3

[0008]

(実施例)以下、図面により本発明を詳細に説明する。

【0009】図1は、本発明の第1の実施例を示す模式 的な図で、本発明に係わる部分だけを示してある。

【0010】本実施例は、レーザ青1の端部の光学窓3 の近等に静ガス室でを設けてガス循環によってもガスの 流れを生じない空間を形成し、ガス循環器4によりガス がはんされても、故電で発生した金属ダストが光学窓 3 の表面に到達しにくい構造を探ると同時に、静ガス室で 内部のガスの流れの無い空間とレーザ苦1内のガス循環 **られる空間の境界に誘導放出光11が通過できる通過穴** 10を育するダスト反発電極3を設置し、この電極8に 負電圧印加電源 9 によって負の電圧を印加する構成を採 ることによって、致電によって大部分の負の電荷に茶電 している金属ダストの静ガス室で内部への侵入をクーロ シカのによって訪いでいる。したがって、光学窓3への 金属ダストの準領・付着が抑制され、長時間にわたり安 定なシーザ出力を得ることが可能になる。また、光学窓 3 のクリーエング及び交換の回数を低減するとができる ため保守が容易になると同時に、ランエングコスト上有 20 利となる。

【0011】なお、放電電磁2、反射鏡6、出力鏡6は 従来通りなのでこれらの説明は省略する。

(0012)図2は、本発明の第2の実施例を示す模式 的な図で、本発明に係わる部分だけを示してある。

【0014】図3は、本発明の第3の実施例を示す模式 40 的な図で、本発明に係わる部分だけを示してある。

【9015】本実施例は、図1の第1の実施例の構成に加えて、ガス循環ポンプ15及びダストフィルタ16をレーデ書1及び幕ガス室でにガス配置17によって直列

に接続し、金属ダストを除去したレーザガスを除力ス室 7からレーザ苦1内に戻す構成を採っている。この構成 を採ることによって、金属ダストは、ダスト反発電圏 8 に印加された負電圧によるケーロンカに加え、ダストを 含まないレーザガスの流れによっても静ガス室 7 への侵 入を抑制される。したがって、光学窓 3 への金属ダスト の理積・付着がさらに抑制され、長時間にわたり安定な レーザ出力を得ることが可能になる。また、光学窓 3 の クリーニング及び交換の回数を低減することができるた り め保守が容易になると同時に、ランニングコスト上有利 となる。

[0016]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の故意励起パルスガスレーザ装置によれば、放電によって発生する金属ダストの光学窓への堆積。付着が少なく、長時間安定なレーザ出力が得られると同時に、光学窓のクリーニング及び交換の回数を低減することができるため保守が容易になると同時に、ランニングコスト上有利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示す模式的な図である。

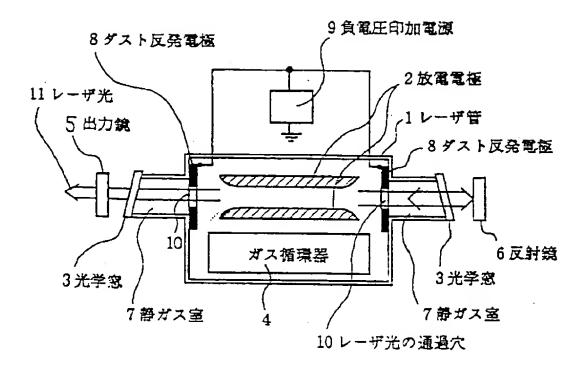
【図 2】 本発明の第 2 の実施例を示す模式的な図である。

【図 3】本発明の第3の実施例を示す模式的な図である。

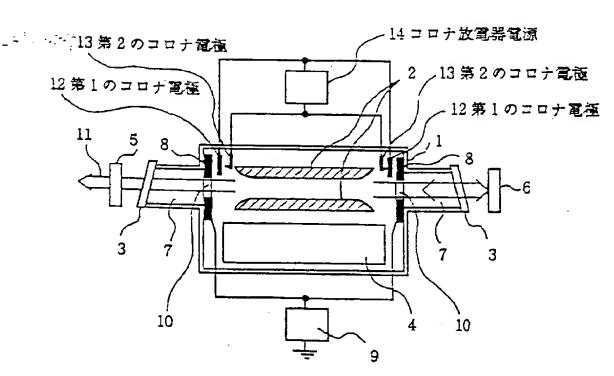
【声号の説明】

- 1 レーデ管
- 2 放電電腦对
- 3 光学窓
- ・ 4 ・ガス循環器
 - 5 出力鏡
 - 6 反射鏡
 - 7 静ガス室
 - 3 ダスト反発電極
 - 9 負銀圧印加電源
 - 10 レーザ光の通過穴
 - 1.1 レーデ光
 - 12 第1のコロナ電極
 - 13 第2のコロナ電極
 - 14 コロナ放電電腦
 - 1.5 ガス循環ポンプ
 - 16 ダストフィルタ
 - 17 ガス配管

[四1]

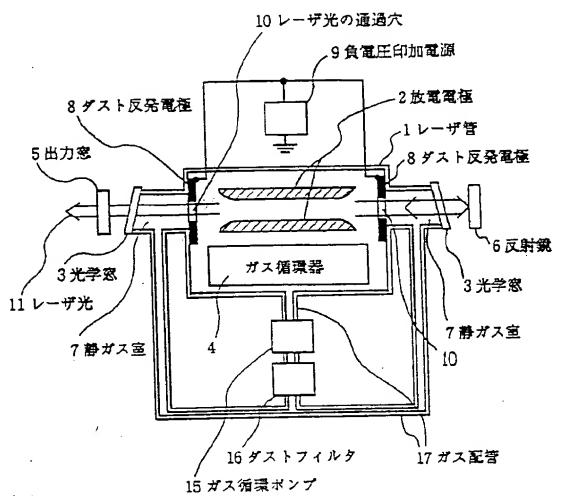


[图2]



· Principle of the state of the

[3]



مخروف

. . .